

## **Especificacions Microscopi electrònic d'escaneig SEM Zeiss EVO MA10**

Fabricant: Carl Zeiss Microscopy GmbH (Jena, Germany)

Any compra: 2010

Model: EVO MA10

Resolució:

- 3 nm a 30 kV
- 4.5 nm a 30kV amb pressió variable
- 10 nm a 3 kV

Rang de pressions: 10–400 Pa

Màxima alçada de la mostra: 100 mm

Detectors:

- Secundaris estàndard (SE)
- Retrodispersats (AsB)
- Secundaris amb pressió variable (VPSE)
- Detector EDS Oxford LINCA X-Max